平4-111211 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

filnt. Cl. 5 G 11 B 5/31 識別配号 庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月13日

Α 7326-5D

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

薄膜磁気ヘッド 60発明の名称

> 頤 平2-230059 创特

顧 平2(1990)8月31日 @出

哥 清官 個発 明 者

茨城県真壁郡関城町関館字大茶367~2 茨城日本電気株

式会社内

の出 頭 人 茨城日本電気株式会社 茨城県真壁郡関城町関館字大茶367-2

70代 理 人 弁理士 高 橋

- 薄膜磁気ヘッド 1. 発明の名称
- 2. 特許請求の範囲

(1). 少なくとも一層のコイルパターンと、こ のコイルパターンを挟む第1及び第2の絶縁パタ - ンと、この第1及び第2の絶縁パターンの全体 を挟む第1及び第2の磁気コアと、前記第2の磁 気コアの外面側に装備された基板とを確え、

前記第1及び第2の磁気コアは、その一端部で ある前記コイルパターンの中心部側が連結される と共に、その他嫡都である前記コイルパターンの 外周部側の一部に書き込み靴み出し用のギャップ が形成されてなる薄膜磁気ヘッドにおいて、

前記ギャップ側に位置する基板と第2の磁気コ アとの間に、段差解梢層を装備したことを特徴と する薄膜磁気ベッド。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、磁気ヘッドに関し、特に磁気ディス

ク装置用の薄膜磁気ヘッドに関する。

(従来の技術)

従来、この種の薄膜磁気ヘッドは、第2図に示 すよう構成になっていた。即ち基板10の上に鉄 ーニッケル合金の薄膜で下部コア13を形成し、 その上に酸化アルミ (A L . O .) 答のギャップ 14層で被覆する。さらに、その上にはポジティ プフォトレジストを加熱硬化させた楕円形状の下 部絶縁暦15と、薬電体のコイル16と、前述し た下部絶縁層15と同じ材料の上部絶縁層17と、 前述した下部コア13と同一パターンの上部コア 18とを順次積層する。

また、各パターンの形成にはフォトリソ技術が 使用されており、フォトマスクと基板10上面と を接触させ、緊外線露光により、フォトレジスト パターンを形成する。その後電気メッキ法等でコ イル16と上部及び下部コア18、13を付ける。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の薄膜ヘッドは、図2に示すようにコイル、絶縁層と積層するに従い、基板10とフォトマスクとの隙間9が大きくなる。このため、フォトリソでの解像度が悪くなる。

薄膜ヘッドが高密度化になるに従い、コイル16、上部コア18の各パターンも微細化されており、解像度の悪化はパターン形成を困難にするという不都合がある。

また、隙間 9 を小さくする方法として、基板 1 0 上に溝をいれ、その上に絶縁層、コイルを形成 する方法がある。しかし、段差部のスロープ形状 形成は、加工方法が複雑になるという欠点がある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、少なくとも一層のコイルバターンと、このコイルパターンを挟む第1及び第2の路縁パターンと、この第1及び第2の絶縁パターンの全体を挟む第1及び第2の磁気コアと、第2の磁気コアの外面側に装備された基板とを備え、第1及び第2の磁気コアは、その一端部であるコイルバ

の一部に、書き込み統み出し用のギャップ?が形成されている。そして、ギャップ?側に位置する基板6と第2の磁気コア5との間に、段差解消層8が装備されている。符号20は保護膜を示し、符号30は記録媒体を示す。

これを更に詳述すると、基板 6 上にノボラック /ナフトキノンジアジド系のポジティブフォトレ ジストを 5 ~ [0 (μm)の厚さにスピンコート し、段差解消漏 8 をパターニングする。

次に、オーブン又はホットプレートで 110~140℃に加熱して流動を起こすことにより、パターンの角部に丸みを帯びさせる。次に 200℃以上に加熱することによりフォトレジストを硬化させ、段差解消器 8 を形成する。その上に第2の磁気コア5、ギャップ7、第2の絶縁パターン3。コイルパターン1、第1の絶縁圏パターン2。第1の磁気コア4を通常の薄膜ヘッドの製造方法で順次形成する。

段差解消層 8 は、第1及び第2の絶縁パターンとポジネガの関係、すなわち絶縁層の形をぬいた

ターンの中心部側が連結されると共に、その他宿部であるコイルパターンの外周部側の一部に書き込み読み出し用のギャップが形成されてなる薄膜磁気へッドにおいて、ギャップ側に位置する基板と第2の磁気コアとの間に、段差解消煙を装備する、という構成を採っている。これによって前述した目的を達成しようとするものである。

(発明の実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図ないし第2図 に基づいて説明する。

第1図において、本実施例は、少なくとも一層のコイルパターン1と、このコイルパターン1を挟む第1及び第2の絶縁パターン2、3の全体を挟む第1及び第2の磁気コア4、5と、第2の磁気コア5の外面側に装備された基板6とを備えている。第1及び第2の磁気コア4、5は、その一端部であるコイルパターンの外周部側に、その他端部であるコイルパターンの外周部側

パターン8(第2図参照)になっており、第1及 び第2の絶縁パターン層2.3が段差解消層8の 凹部に入るようになっている。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によると、段差解消にフォトレジストを用いることにより、段差解消膜層の膜厚の均一化および段差解消層の側壁のスロープを形成することができる。また、段差解消により高段差部を小さくし、フォトリソの解像度を上げることにより、第1の磁気コア、コイルパターン等の微細パターン形成が可能となる、という従来にない優れた薄膜磁気ヘッドを提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

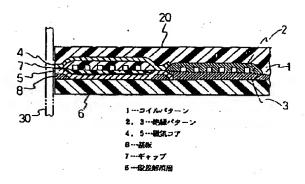
第1図は本発明の一実施例の断面図、第2図は 第1図の段差解情層のパターンを示す説明図、第 3図は従来例を示す断面図である。

1 ……段差解消圧、2, 3 ……絶縁パターン、

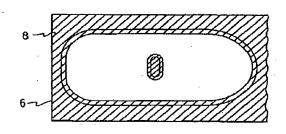
特別平4-111211(8)

4,5……磁気コア、6……基板、7……ギャップ、8…… 段差解消層。

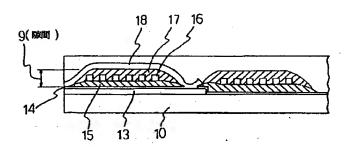
新 1 図



第 2 図



第 3 図



THE PAGE BLANK USPILL

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-111211

(43)Date of publication of application: 13.04.1992

(51)Int.CI.

G11B 5/31

(21)Application number: 02-230059

(71)Applicant: NEC IBARAKI LTD

(22)Date of filing:

31.08.1990 (72)Inv

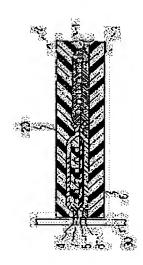
(72)Inventor: KIYOMIYA KENJI

(54) THIN-FILM MAGNETIC HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the resolution of photolithography and allow the formation of fine patterns by providing a step eliminating layer between a substrate positioned on a gap side and a 2nd magnetic core.

CONSTITUTION: This magnetic head has at least one layer of coil patterns 1, 1st and 2nd insulating patterns 2, 3 holding the coil patterns 1 in-between, 1st and 2nd magnetic cores 4, 5 holding the entire part of the insulating patterns in-between, and the substrate 6 provided on the outside surface side of the 2nd magnetic core 5. The 1st and 2nd magnetic cores 4, 5 are connected on the central part side of the coil patterns which are at one end. In addition, a gap 7 for writing and reading out is formed in a part on the outer peripheral part side of the coil patterns which are the other end thereof. The step eliminating layer 8 is provided between the substrate 6 positioned on the gap 7 side and the 2nd magnetic core 5. The resolution of the photolithography is enhanced and the formation of the finer patterns is possible.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THE OF THE PROPERTY OF THE PRO

Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 4-111211

2. Claim

(1) A thin-film magnetic head comprising at least one layer of coil pattern; first and second insulating patterns that sandwich the coil pattern; first and second magnetic cores that entirely sandwich the first and second insulating patterns; and a substrate disposed on an outer surface of the second magnetic core,

wherein first ends of the first and second magnetic cores adjacent to a central portion of the coil pattern are coupled to each other, whereas second ends thereof adjacent to an outer periphery portion of the coil pattern form a gap therebetween used for reading and writing, and

wherein a section of the substrate adjacent to the gap and the second magnetic core have a step-eliminating layer disposed therebetween.

THE PREE BLANK DEPTO

 \mathcal{X}